

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

B65D 25/24 (2006.01)

B65D 81/20 (2006.01)



## [12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920052372.3

[45] 授权公告日 2009年12月30日

[11] 授权公告号 CN 201371993Y

[22] 申请日 2009.3.11

[21] 申请号 200920052372.3

[73] 专利权人 广州隆超塑料五金制造有限公司

地址 510450 广东省广州市白云区石井镇龙湖村

[72] 发明人 黄伟

[74] 专利代理机构 广州市南锋专利事务所有限公司

代理人 刘嫒

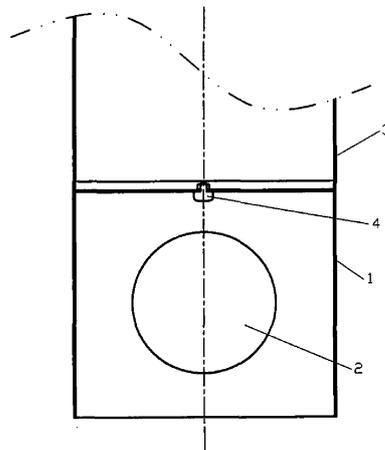
权利要求书1页 说明书1页 附图1页

### [54] 实用新型名称

一种开有操作孔的真空器皿底座

### [57] 摘要

本实用新型公开了一种开有操作孔的真空器皿底座，所述底座的侧面上开一个操作孔，所述操作孔的直径根据器皿容积大小可取 80-200mm，能够方便使用者的双手可轻松的在底座内部进行清洗或其他作业。由于本实用新型采用的底座带有操作孔，故能够及时清除底座内部的脏污和进行其它底座内部的操作，使产品的使用更卫生，大大方便了使用者，同时，避免了因采用翻转或举高底座的传统方式而造成的安全陷患，使底座在使用的过程中更安全可靠。



- 
- 1、一种开有操作孔的真空器皿底座，其特征在于：所述底座（1）的侧面上设有一个能对底座的内部进行清洗或其它操作的操作孔（2）。
  - 2、根据权利要求1所述的开有操作孔的真空器皿底座，其特征在于：所述操作孔（2）的直径根据器皿容积大小可取 80-200mm。

---

## 一种开有操作孔的真空器皿底座

### 技术领域

本实用新型涉及一种真空器皿底座，具体是指一种开有操作孔的真空器皿底座。

### 背景技术

目前，真空器皿的底座多为圆桶结构，在使用的过程中，若需清洗底座内部或在底座内部进行其他操作，需要把底座翻转或举高，这种操作方式，不仅费时费力，提高了操作难度，给使用者带来了诸多不便，而且还会因移动底座的过程中，可能会出现底座脱手掉在地上或砸在脚上，给底座本身或操作者造成一定的安全威胁，故大大降低了使用的安全系数。

### 发明内容

本实用新型的目的在于提供一种便于在底座的内部清洗或进行其他操作的开有操作孔的真空器皿底座。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种开有操作孔的真空器皿底座，所述底座的侧面上开一个操作孔，所述操作孔的直径根据器皿容积大小可取 80-200mm，能够方便使用者的双手可轻松的在底座内部进行清洗或其他作业。

本实用新型具有以下有益效果：由于本实用新型采用的底座带有操作孔，故能够及时清除底座内部的脏污和进行其它底座内部的操作，使产品的使用更卫生，大大方便了使用者，同时，避免了因采用翻转或举高底座的传统方式而造成的安全隐患，使底座在使用的过程中更安全可靠。

### 附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

图 1 为本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

如图 1 所示，一种开有操作孔的真空器皿底座，所述底座 1 的侧面上开一个圆孔作为操作孔 2，所述圆孔的直径根据器皿容积大小可取 80-200mm，能够方便使用者的双手可轻松的在底座内部进行清洗或其他作业。

在有底座内部操作需求时，把手直接从侧面的操作孔 2 伸入即可对底座 1 的内部进行清洗操作，还可旋紧或卸下固定底座 1 与真空器皿 3 的螺丝 4，实现真空器皿 3 与底座 1 之间拆装操作。

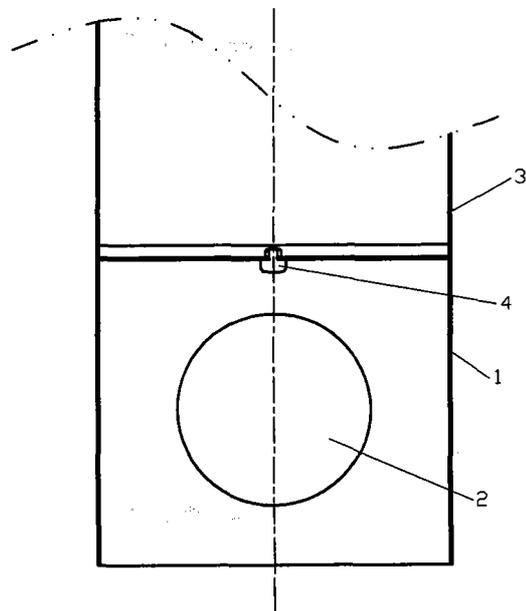


图1